

國立中山大學貴重暨共用儀器中心儀器計費一覽表

學術服務領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫預約單價	非計畫預約單價	自行操作計畫計費單價	自行操作非計畫計費單價
年度					112	112	112	112
化學								
1	電子順磁共振光譜儀	水氧敏感樣品前處理	sample preparation for O ₂ -/moisture-sensitive compound	單一樣品	200	200	0	0
		汞燈照射	irradiation with UV lamp	單一樣品15分鐘內每單一波長	150	150	150	150
		汞燈照射(超過15分鐘後)	irradiation with UV lamp	單一樣品15分鐘內每單一波長	100	100	100	100
		汞燈裝置架設	installation fee for UV lamp equipments	單一預約序號	400	400	400	400
		其他	else	單位	100	100	100	100
		非水氧敏感樣品前處理	sample preparation for O ₂ -/moisture-stable compound	單一樣品	100	100	100	100
		室溫基本量測	measurement at room temperature	單一樣品	150	150	150	150
		液氮變溫測量架設	installation fee for liquid-helium equipments	單一預約序號	1,200	1,200	1,200	1,200
		液氮變溫量測	variable-temperature measurement (4K - 340 K)	單一樣品當一溫度/120分鐘	300	300	300	300
		液氮定溫量測	mearement at constant temperature	150分鐘	200	200	200	200
		液氮變溫量測	variable-temperature measurement (77K - 340 K)	單一樣品每單一溫度/30分鐘	300	300	300	300
		液氮變溫裝置架設	Installation of liquid nitrogen variable temperature measuring device	1 次	1,000	1,000	1,000	1,000
		電化學量測	electrochemical measurement	每件30分鐘	200	200	200	200
		電化學裝置架設	installation fee for electrochemistry equipments	單一預約序號	600	600	600	600
2	基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜儀	ESI低解析一次質譜定性分析	ESI/QQQ/MS	件	300	1,500	0	0
		ESI低解析二次質譜分析(含一次質譜定性分析)	ESI/Q-TOF/MS/MS	訊號峰	350	1,800	0	0
		GC/MS 一次質譜定性分析	GC/MS	件	500	1,000	0	0
		GC/MS 資料庫搜尋	GC/MS database searching	訊號峰	50	100	0	0
		HPLC/ESI/QQQ 一次質譜定性分析	HPLC/ESI/QQQ/MS	件	1,200	3,000	0	0
		HPLC/ESI/QQQ 二次質譜分析(含一次質譜定性分析)	HPLC/ESI/QQQ/MS/MS	訊號峰	50	100	0	0
		LCMS定量分析	HPLC/ESI/QQQ/MS/MS Quantification	件	8,000	10,000	0	0
		LCMS層析條件優化	chromatographic conditions	件	3,000	6,000	0	0
		MALDI 二次質譜分析(含一次質譜定性分析)	MALDI-TOF/MS/MS	件	350	1,800	0	0
		MALDI 影像質譜	MALDI Imaging	件	10,000	50,000	0	0
		MALDI一次質譜定性分析	MALDI-TOF/MS	件	300	1,500	0	0
		TD-ESI 一次質譜定性分析	TD-ESI/MS	件	300	600	0	0
		TD-ESI 二次質譜定性分析(含一次質譜定性分析)	TD-ESI/MS/MS	訊號峰	1,800	1,800	1,800	1,800
		資料檢索	Database search	次	20	20	0	0

學術服務領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫預約單價	非計畫預約單價	自行操作計畫計費單價	自行操作非計畫計費單價
年度					112	112	112	112
化學								
3	600MHz 核磁共振儀(JEOL ECZ-600R)	1D自行處理圖譜	1D EXP without processing	每半小時	50	500	50	500
		每樣品前半小時	the first 0.5hr /per sample	半小時	130	600	130	600
		夜間實驗	overnight EXP	12小時	600	6,000	600	6,000
		超過半小時者·每半小時	after 0.5hr,per 0.5hr	半小時	80	500	80	500
		變溫實驗	VT experiment	改變溫度每單位	200	200	0	0
4	超高效能傅立葉轉換電場軌道質譜儀	ESI低解析-複製-複製	ESI	件數	200	1,600	0	0
		LCMS	LCMS	小時	2,000	4,000	0	0
		高解析度 ESI複製	high resolution mass(ESI)	件數	320	3,000	0	0
		資料分析-複製	data processing	件數	150	500	0	0
材料								
1	多功能 X 光繞射儀	X光反射率	XRR	每件30分鐘,超時累計	120	800	120	800
		x光掠角繞射	Grazing Incident Diffraction X-ray	每件30分鐘,超時累計	120	800	120	800
		相鑑定	data search	每件	100	100	100	100
		高解析磊晶繞射分析	High Resolution X-ray	每件30分鐘,超時累計	120	800	120	800
		結晶方位分布函數	ODF	一組	200	1,000	200	1,000
		超時計費	Overtime billing	每30分鐘	120	800	120	800
		極圖量測分析	pole figure	每件30分鐘,超時累計	120	800	120	800
1.1	粉末繞射儀	一般繞射分析	powder diffraction	每件30分鐘,超過則累計	100	600	100	600
		相鑑定	件	每件	100	600	100	600
2	歐傑電子能譜儀	AUGER 全能譜	AUGER WILD SCAN	小時	350	3,000	350	3,000
		AUGER元素影像掃描	AUGER MAPPING	小時	350	3,000	350	3,000
		AUGER單元素能譜圖	AUGER NARROW SCAN	小時	350	3,000	350	3,000
		AUGER縱深分布圖	AUGER DEPTH	小時	350	3,000	350	3,000
		XPS化學態/成分分析	XPS WILD SCAN AND NARROW SCAN	小時	350	3,000	350	3,000
		XPS縱深分布圖	XPS DEPTH	小時	350	3,000	350	3,000
3	高解析電子探儀	定量分析	Quantitative analysis	點	20	100	10	50
		線分析、面分析、定性分析	mapping and line scan	次	80	300	40	150
		燈絲使用時間	basic expense	小時	600	1,200	450	900
4	FEG-TEM Tecnai F20 G2 場發射穿透式電子顯微鏡	EDS 分析 (點·線·面分析) -複製	EDS Analysis (Point · Line scan · Mapping)	小時	100	300	50	0
		NBD/CBD 繞射分析-複製	NBD/CBD Analysis	小時	100	300	50	0
		STEM 分析 (HAADF) -複製	STEM Analysis (HAADF)	小時	100	300	50	0
		高解析成像分析-複製	HR Analysis	小時	100	300	50	0
		電子能量損失能譜 EELS/GIF分析-複製	EELS/GIF Analysis	小時	200	600	100	0
		儀器使用費·每時段3小時/1小時計費一次-複製	user charge (3 hours per session)	小時	600	2,000	300	0
		CCD 照相	Number of photon	張	10	10	10	0
5	JEOL 3010 TEM 穿透式電子顯微鏡	元素分析(點)-複製	EDS(point)	小時	100	100	100	0
		高解析晶格影像觀察-複製	HR use	小時	100	100	100	0
		燈絲使用	Filament use	小時	400	1,500	200	0

學術服務領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫預約單價	非計畫預約單價	自行操作計畫計費單價	自行操作非計畫計費單價
年度					112	112	112	112
材料								
6	多功能高解析場發射型掃描式電子顯微鏡	多功能高解析掃描式電子顯微鏡	Zeiss G450 Field Emission Electron Microscope	小時	400	2,500	250	2,500
		能量分散分析儀面分析	Energy Dispersive Spectrometer-Mapping	次	100	200	100	200
		能量分散分析儀線分析	Energy Dispersive Spectrometer-Line scan	次	100	200	100	200
		能量分散分析儀點分	Energy Dispersive Spectrometer- Point	點	50	100	50	100
		數位影像處理與傳輸	Digital Image Processing	張	10	50	10	50
7	軟物質分析穿透式電子顯微鏡	形態觀察分析及繞射分析-複製	Morphology and Diffraction Analysis	時段	1,800	6,000	600	0
		能量分散光譜儀(EDS)點分析-複製	EDS	點	100	300	100	300
8	場發射型掃描式電子顯微鏡	能量分散分析儀面分析	Energy Dispersive Spectrometer-Mapping	次	100	200	100	200
		能量分散分析儀線分析	Energy Dispersive Spectrometer-Line scan	次	100	200	100	200
		能量分散分析儀點分析	Energy Dispersive Spectrometer- Point	點	50	100	50	100
		陰極螢光測試儀常溫	Crygenic Cathodoluminescence system-normal temperature	小時	150	250	150	250
		場放射型掃描式電子顯微鏡	JEOL 6330 TF Field Emission Electron Microscope	小時	300	1,500	200	1,500
		數位影像處理與傳輸	Digital Image Processing	張	10	10	10	10
9	環境掃描式電子顯微鏡	EDS分析及Mapping分析-複製	EDS and Mapping analyze	次 (times)	100	200	100	200
		ESEM模式之試件冷凍及加熱服務-複製	Freezing and heating service of specimens in ESEM mode	3小時 (3hr)	1,000	3,300	1,000	3,300
		高真空模式之SEI及BEI影像觀察及照相-複製	High vacuum mode SEI & BEI observe	1小時 (1hr)	250	1,000	250	1,000
		試片鍍金 (gold plating)-複製	gold plating	次 (times)	200	200	200	200
奈米製程								
1	光學微影系統	Si wafer-複製	Si wafer	1片	600	600	600	600
		重新訓練費-複製	Retraining fee	1次	300	300	0	0
		重新認證費-複製	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費-複製	Training fee	1次	600	600	0	0
		認證費-複製	Certification fee	1次	600	600	0	0
		儀器使用費-複製	measurement	0.25小時	350	550	150	350
2	多靶磁控濺鍍系統	重新訓練費-複製	Retraining fee	1次	550	550	0	0
		重新認證費-複製	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費-複製	Training fee	1次	1,100	1,100	0	0
		認證費-複製	Certification fee	1次	600	600	0	0
		儀器使用費-複製	measurement	0.25小時	420	500	250	450
3	快速退火系統	Si wafer-複製	Si wafer	1片	600	600	600	600
		重新訓練費-複製	Retraining fee	1次	300	300	0	0
		重新認證費-複製	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費-複製	Training fee	1次	600	600	0	0
		認證費-複製	Certification fee	1次	600	600	0	0
		儀器使用費-複製	measurement	0.25小時	250	300	110	280

學術服務領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫預約單價	非計畫預約單價	自行操作計畫計費單價	自行操作非計畫計費單價
年度					112	112	112	112
奈米製程								
4	高密度電漿化學氣相沉積系統	重新訓練費-複製	Retraining fee	1次	850	850	0	0
		重新認證費-複製	Recertification fee	1次	350	350	0	0
		訓練費-複製	Training fee	1次	1,700	1,700	0	0
		認證費-複製	Certification fee	1次	700	700	0	0
		儀器使用費-複製	measurement	0.25小時	650	750	350	650
5	感應耦合式電漿蝕刻系統	重新訓練費-複製	Retraining fee	1次	850	850	0	0
		重新認證費-複製	Recertification fee	1次	350	350	0	0
		訓練費-複製	Training fee	1次	1,700	1,700	0	0
		認證費-複製	Certification fee	1次	700	700	0	0
		儀器使用費-複製	measurement	0.25小時	650	750	350	650
6	薄膜特性分析儀	Si wafer-複製	Si wafer	1片	600	600	600	600
		光碟片-複製	CD	1片	10	10	10	10
		重新訓練費-複製	Retraining fee	1次	300	300	0	0
		重新認證費-複製	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費-複製	Training fee	1次	600	600	0	0
		認證費-複製	Certification fee	1次	600	600	0	0
		儀器使用費-複製	measurement	0.25小時	300	450	200	400
7	雙電子槍蒸鍍機	Mo坩鍋-複製	Mo crucible	1個	2,500	2,500	2,500	2,500
		重新訓練費-複製	Retraining fee	1次	550	550	0	0
		重新認證費-複製	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費-複製	Training fee	1次	1,100	1,100	0	0
		認證費-複製	Certification fee	1次	600	600	0	0
		儀器使用費-複製	measurement	0.25小時	420	500	250	450
物理								
1	物理性質量測系統	外加磁場量測	applied magnetic field measurement	小時	600	1,600	0	0
		零磁場量測	0 Tesla measurement	小時	600	1,600	0	0
		樣品準備費	sample preparation	件	1,000	1,000	1,000	1,000
2	超導量子干涉磁量儀	液氦使用費-複製		小時	400	1,000	400	1,000
		儀器使用時間-複製-複製	Measurement time in SQUID	小時	400	1,000	400	1,000
3	常壓雙光源光電子能譜儀	UPS分析	UPS	小時	400	4,000	0	0
		Ar 離子槍(表面清潔、深度分析)	Ar ion bombardment	小時	100	1,000	0	0
		X射線光電子能譜分析	monochromated xps	小時	350	3,500	0	0
		加開電子槍	Charge neutralization	小時	50	500	0	0
4	高階三束型聚焦離子束顯微鏡	高階三束型聚焦離子束顯微鏡	FIB	1小時	3,000	8,000	3,000	8,000
		高階三束型聚焦離子束顯微鏡(0.25hr)	FIB(0.25hr)	0.25小時	750	2,000	750	2,000
		高階三束型聚焦離子束顯微鏡(廠商)	FIB(Vendor)	1小時	0	8,000	8,000	8,000
		高階三束型聚焦離子束顯微鏡(廠商0.25hr)	FIB(vendor 0.25hr)	0.25小時	0	2,000	2,000	2,000
		鍍白金	Pt coating	1次	300	300	300	300
		鍍碳銅網	copper grid	1片	60	60	60	60
		鍍碳銅網試片盒	grid box	1盒	200	200	0	0
5	高解析度探針顯微鏡	自行量測-複製	Self-measurement	小時	500	0	500	0
		委託量測-複製	Commissioned measurement	小時	900	3,500	0	0
5.1	變溫探針顯微鏡	委託量測-複製	Commissioned measurement	小時	900	3,500	0	0
		特殊探針費用-複製	tips	小時	1,500	1,500	0	0